

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0029 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター
法人の名称	一般財団法人日本品質保証機構 法人番号 9010005016585
問い合わせ窓口	営業課 TEL : 042-679-0144 FAX : 042-679-0187



20230119評基第009号
2024年3月29日

認定証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認定識別: JCSS 0029 Calibration

適合性評価機関の名称: 一般財団法人日本品質保証機構
計量計測センター

法人の名称: 一般財団法人日本品質保証機構

適合性評価機関の所在地: 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4号

認定範囲: 長さ、質量、温度、角度、流量・流速、
振動加速度、電気（高周波）及び電磁界、
力、音響・超音波、放射線・放射能・中性子、
硬さ、湿度（詳細は別紙のとおり）

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書（JCSS 認定）に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2024年3月29日

認定の有効期限: 2028年3月28日

初回認定発効日: 1994年5月2日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 齋藤和則

- ・ IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：1994年5月2日

国際MRA対応初回認定発効日：1994年5月2日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：波長計量器、一次元寸法測定器、形状測定器〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
波長計量器	633 nm 領域の波長		4.2×10^{-11}
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (光波干渉測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.02 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	$(0.01+L/3500) \mu\text{m}$
		250 mm 超 400 mm 以下	$(0.02+L/3400) \mu\text{m}$
		400 mm 超 800 mm 以下	$(0.02+L/3200) \mu\text{m}$
		800 mm 超 1000 mm 以下	$(0.02+L/3100) \mu\text{m}$
	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.07 μm
		100 mm 超 500 mm 以下	$(0.005+L/1800) \mu\text{m}$
		500 mm 超 1000 mm 以下	$(0.025+L/1800) \mu\text{m}$
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による)	0.1 mm 以上 1010 mm 以下	$(0.2+L/650) \mu\text{m}$
	標準尺	300 mm 以下	0.4 μm
		300 mm 超 1000 mm 以下	$(0.2+L/1500) \mu\text{m}$
	伸び計校正器	25 mm 以下	0.3 μm
		25 mm 超 50 mm 以下	0.4 μm
		50 mm 超 75 mm 以下	0.5 μm
75 mm 超 100 mm 以下		0.6 μm	
伸び計	5 mm 以下	0.8 μm	
	5 mm 超 50 mm 以下	2.4 μm	
	50 mm 超 600 mm 以下	6.4 μm	
形状測定器	一次元回折格子	97 nm 以上 1000 nm 以下	0.03 nm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注) 波長計量器の校正測定能力は、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいません。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	伸び計	5 mm 以下	0.8 μm
		5 mm 超 50 mm 以下	2.4 μm
		50 mm 超 600 mm 以下	6.4 μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：1996年11月14日

国際MRA対応初回認定発効日：1996年11月14日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：分銅等、はかり〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)		
			等量比較による校正		等量比較以外の 方法による校正
			協定質量の校正	真の質量値の校正	協定質量の校正
分銅等	分銅、おもり	50 kg	0.30 g	12 µg/g	—
		20 kg 超 50 kg 未満	5.0 µg/g	12 µg/g	—
		20 kg	7.0 mg	11 µg/g	6.0 mg
		10 kg 超 20 kg 未満	4.0 µg/g	11 µg/g	—
		10 kg	3.0 mg	4.0 µg/g	2.1 mg
		5 kg 超 10 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		5 kg	1.8 mg	4.0 µg/g	1.1 mg
		3 kg 超 5 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		3 kg	1.5 mg	4.0 µg/g	—
		2 kg 超 3 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		2 kg	0.60 mg	4.0 µg/g	0.42 mg
		1 kg 超 2 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		1 kg	0.20 mg	4.0 µg/g	0.16 mg
		500 g 超 1 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		500 g	0.11 mg	4.0 µg/g	0.085 mg
		300 g 超 500 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		300 g	0.15 mg	4.0 µg/g	—
		200 g 超 300 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		200 g	0.060 mg	4.0 µg/g	0.035 mg
		100 g 超 200 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		100 g	0.030 mg	4.0 µg/g	0.019 mg
		50 g 超 100 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		50 g	0.020 mg	4.1 µg/g	0.010 mg
		30 g 超 50 g 未満	5.0 µg/g	4.7 µg/g	—
		30 g	0.026 mg	5.4 µg/g	—
		20 g 超 30 g 未満	8.0 µg/g	9.0 µg/g	—
		20 g	0.015 mg	8.7 µg/g	0.0080 mg
		10 g 超 20 g 未満	9.0 µg/g	10 µg/g	—
		10 g	0.010 mg	15 µg/g	0.0060 mg
		5 g 超 10 g 未満	15 µg/g	17 µg/g	—
5 g	0.0080 mg	25 µg/g	0.0050 mg		
3 g 超 5 g 未満	32 µg/g	35 µg/g	—		
3 g	0.013 mg	56 µg/g	—		
2 g 超 3 g 未満	25 µg/g	28 µg/g	—		
2 g	0.0060 mg	60 µg/g	0.0040 mg		
1 g 超 2 g 未満	40 µg/g	60 µg/g	—		
1 g	0.0050 mg	81 µg/g	0.0030 mg		
500 mg 超 1 g 未満	50 µg/g	90 µg/g	—		
500 mg	0.0040 mg	0.15 mg/g	0.0025 mg		
200 mg 超 500 mg 未満	80 µg/g	0.15 mg/g	—		

		200 mg	0.0030 mg	0.17 mg/g	0.0020 mg
		100 mg 超 200 mg 未満	0.16 mg/g	0.20 mg/g	—
		100 mg	0.0025 mg	0.22 mg/g	0.0015 mg
		50 mg 超 100 mg 未満	0.25 mg/g	0.30 mg/g	—
		50 mg	0.0020 mg	0.30 mg/g	0.0012 mg
		20 mg 超 50 mg 未満	0.45 mg/g	0.45 mg/g	—
		20 mg	0.0016 mg	0.70 mg/g	0.0010 mg
		10 mg 超 20 mg 未満	0.90 mg/g	0.90 mg/g	—
		10 mg	0.0012 mg	1.1 mg/g	0.00080 mg
		5 mg 超 10 mg 未満	1.6 mg/g	1.6 mg/g	—
		5 mg	0.0011 mg	1.8 mg/g	0.00060 mg
		2 mg 超 5 mg 未満	3.2 mg/g	3.2 mg/g	—
		2 mg	0.0011 mg	4.3 mg/g	0.00060 mg
		1 mg 超 2 mg 未満	6.0 mg/g	6.0 mg/g	—
		1 mg	0.0011 mg	9.0 mg/g	0.00060 mg
		0.8 mg	0.0016 mg	—	—
		0.6 mg	0.0014 mg	—	—
		0.5 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.4 mg	0.0014 mg	—	—
		0.2 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.1 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.05 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正
校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	150 kg 超 600 kg 以下	16 µg/g	16 µg/g
		20 kg 超 150 kg 以下	9.6 µg/g	9.6 µg/g
		20 kg	3.0 µg/g	3.0 µg/g
		100 g 超 20 kg 未満	1.1 µg/g	1.1 µg/g
		100 g	0.97 µg/g	0.97 µg/g
		50 g 超 100 g 未満	1.8 µg/g	1.8 µg/g
		50 g	1.2 µg/g	1.2 µg/g
		20 g 超 50 g 未満	2.8 µg/g	2.8 µg/g
		10 g 超 20 g 以下	2.4 µg/g	2.4 µg/g
		10 g	3.6 µg/g	3.6 µg/g
		5 g 超 10 g 未満	8.8 µg/g	8.8 µg/g
		5 g	5.9 µg/g	5.9 µg/g
		2 g 超 5 g 未満	14 µg/g	14 µg/g
		1 g 超 2 g 以下	12 µg/g	12 µg/g
		1 g	18 µg/g	18 µg/g
		500 mg 超 1 g 未満	45 µg/g	45 µg/g
		500 mg	30 µg/g	30 µg/g
		200 mg 超 500 mg 未満	71 µg/g	71 µg/g
		100 mg 超 200 mg 以下	59 µg/g	59 µg/g
		100 mg	94 µg/g	94 µg/g
50 mg 超 100 mg 未満	0.22 mg/g	0.22 mg/g		
50 mg	0.15 mg/g	0.15 mg/g		

		20 mg 超 50 mg 未満	0.36 mg/g	0.36 mg/g
		10 mg 超 20 mg 以下	0.30 mg/g	0.30 mg/g
		10 mg	0.47 mg/g	0.47 mg/g
		5 mg 超 10 mg 未満	1.4 mg/g	1.4 mg/g
		5 mg	0.71 mg/g	0.71 mg/g
		2 mg 超 5 mg 未満	2.4 mg/g	2.4 mg/g
		2 mg	1.8 mg/g	1.8 mg/g
		1 mg	3.6 mg/g	3.6 mg/g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：温度

法律に基づく初回登録年月日：2014年11月13日

国際MRA対応初回認定発効日：2014年11月13日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：接触式温度計 [2024年3月29日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	ガラス製温度計	0 °C以上 50 °C以下		0.04 °C
		-40 °C以上 100 °C未満		0.03 °C
	指示計器付温度計 (比較校正法)	100 °C		0.04 °C
		100 °C 超 200 °C 以下		0.06 °C
		200 °C 超 300 °C 以下		0.08 °C
		恒温槽装備	-40 °C 以上 300 °C 以下	0.4 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	指示計器付温度計 (比較校正法)	恒温槽装備	-40 °C 以上 300 °C 以下	0.4 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：角度

法律に基づく初回登録年月日：2006年3月1日

国際MRA対応初回認定発効日：2006年3月1日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：角度測定器〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
角度測定器	ロータリエンコーダ	0° ~ 360°	225,000 点以下	0.05"
	ロータリエンコーダ 校正装置(自己校正装置)	0° ~ 360°		0.04"

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2001年2月20日

国際MRA対応初回認定発効日：2001年2月20日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：気体流速計〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
気体流速計	気体用流速計 (微風速)	0.05 m/s 以上 0.30 m/s 未満	0.019 m/s
		0.30 m/s 以上 0.59 m/s 未満	0.023 m/s
		0.59 m/s 以上 0.88 m/s 未満	0.028 m/s
		0.88 m/s 以上 1.21 m/s 未満	0.036 m/s
		1.21 m/s 以上 1.50 m/s 未満	0.042 m/s
	気体用流速計 (中流速)	1.3 m/s	0.05 m/s
		1.3 m/s 超 3 m/s 以下	0.06 m/s
		3 m/s 超 5 m/s 以下	0.06 m/s
		5 m/s 超 7 m/s 以下	0.08 m/s
		7 m/s 超 10 m/s 以下	0.11 m/s
		10 m/s 超 15 m/s 以下	0.15 m/s
		15 m/s 超 20 m/s 以下	0.20 m/s
		20 m/s 超 25 m/s 以下	0.26 m/s
		25 m/s 超 30 m/s 以下	0.32 m/s
		30 m/s 超 35 m/s 以下	0.38 m/s
35 m/s 超 40 m/s 以下	0.44 m/s		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：振動加速度

法律に基づく初回登録年月日：2005年2月21日

国際MRA対応初回認定発効日：2005年2月21日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：振動加速度測定装置等〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
振動加速度測定装置等	振動加速度計 (電圧感度)	0.5 Hz	1.3 %
		0.63 Hz	1.1 %
		0.8 Hz	1.1 %
		1 Hz	0.8 %
		1.25 Hz	0.7 %
		1.6 Hz	0.7 %
		2 Hz	0.7 %
		2.5 Hz	0.7 %
		3.15 Hz	0.7 %
		4 Hz	0.7 %
		5 Hz	0.7 %
		6.3 Hz	0.7 %
		8 Hz	0.7 %
		10 Hz	0.7 %
		12.5 Hz	0.7 %
		16 Hz	0.7 %
		20 Hz	0.5 %
		25 Hz	0.5 %
		31.5 Hz	0.5 %
		40 Hz	0.5 %
		50 Hz	0.5 %
		63 Hz	0.5 %
		80 Hz	0.5 %
		100 Hz	0.5 %
		125 Hz	0.5 %
		160 Hz	0.5 %
		200 Hz	0.5 %
		250 Hz	0.5 %
315 Hz	0.5 %		
400 Hz	0.6 %		
500 Hz	0.5 %		
630 Hz	0.5 %		
800 Hz	0.5 %		
1 kHz	0.5 %		
1.25 kHz	0.5 %		
1.6 kHz	0.5 %		

		2 kHz	0.6 %
		2.5 kHz	0.7 %
		3.15 kHz	0.7 %
		4 kHz	0.7 %
		5 kHz	0.7 %
		6.3 kHz	0.8 %
		8 kHz	0.8 %
		10 kHz	0.8 %
	振動加速度計 (電荷感度)	20 Hz	0.6 %
		25 Hz	0.6 %
		31.5 Hz	0.6 %
		40 Hz	0.6 %
		50 Hz	0.6 %
		63 Hz	0.6 %
		80 Hz	0.6 %
		100 Hz	0.6 %
		125 Hz	0.6 %
		160 Hz	0.6 %
		200 Hz	0.6 %
		250 Hz	0.7 %
		315 Hz	0.7 %
		400 Hz	0.7 %
		500 Hz	0.6 %
		630 Hz	0.6 %
		800 Hz	0.6 %
		1 kHz	0.6 %
		1.25 kHz	0.6 %
		1.6 kHz	0.6 %
		2 kHz	0.7 %
		2.5 kHz	0.8 %
		3.15 kHz	0.8 %
		4 kHz	0.8 %
	5 kHz	0.8 %	
	6.3 kHz	0.9 %	
	8 kHz	0.9 %	
	10 kHz	0.9 %	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2024年2月16日

校正手法の区分の呼称〔登録年月日〕：直流・低周波測定器等〔2024年2月16日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	電荷測定装置	電荷	-100 nC 以上 -5 nC 以下 +5 nC 以上 +100 nC 以下	0.49 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

※電気（直流・低周波）はMRA対応ではありません。

登録（認定）に係る区分：電気（高周波）及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日：1995年6月21日

国際MRA対応初回認定発効日：1995年6月21日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：高周波測定器等、レーザパワー測定器等〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)		
高周波測定器等	高周波電力発生装置	50 MHz		1 mW	0.45 %	
		10 MHz 以上 12 GHz 以下		1 mW	1.2 %	
				10 pW 以上 10 nW 未満	1.8 %	
				10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %	
	高周波電力測定装置	同軸 7 mm	10 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 500 MHz, 700 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz		1 mW	0.53 %
			7 GHz, 8 GHz		1 mW	0.76 %
			9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz		1 mW	0.88 %
			13 GHz		1 mW	0.92 %
			14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz		1 mW	1.4 %
			10 MHz 以上 200 MHz 以下		1 mW	0.7 %
					1 μW	0.9 %
					10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
					100 mW 超 180 W 以下	2.1 %
			200 MHz 超 400 MHz 以下		1 mW	0.7 %
					1 μW	0.9 %
					10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
100 mW 超 100 W 以下	2.1 %					
400 MHz 超 500 MHz 以下		1 mW	0.7 %			
		1 μW	0.9 %			
		10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %			

			100 mW 超 60 W 以下	2.1 %		
			500 MHz 超 1 GHz 以下	1 mW	0.7 %	
				1 μ W	0.9 %	
				10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %	
				100 mW 超 40 W 以下	2.1 %	
			1 GHz 超 2 GHz 以下	1 mW	0.7 %	
				1 μ W	0.9 %	
				10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %	
				100 mW 超 20 W 以下	2.1 %	
			2 GHz 超 6 GHz 以下	1 mW	0.7 %	
				1 μ W	0.9 %	
				10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %	
		6 GHz 超 12 GHz 以下	1 mW	1.0 %		
			1 μ W	1.2 %		
			10 nW 以上 50 mW 以下	1.6 %		
		12 GHz 超 18 GHz 以下	1 mW	1.6 %		
			1 μ W	2.0 %		
		同軸 2.9 mm	10 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 500 MHz, 700 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz	1 mW	1.1 %	
			13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz, 20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz	1 mW	1.5 %	
			26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz, 40 GHz	1 mW	3.1 %	
			10 MHz 以上 12 GHz 以下	1 mW	1.6 %	
			12 GHz 超 25 GHz 以下	1 mW	2.3 %	
			25 GHz 超 40 GHz 以下	1 mW	4.7 %	
			高周波 電圧測定装置	10 MHz 以上 50 MHz 以下	0.2 V 以上 0.9 V 以下	0.50 %
				50 MHz 超 500 MHz 以下	0.2 V 以上 0.9 V 以下	0.80 %
		500 MHz 超 1000 MHz 以下		0.2 V 以上 0.9 V 以下	1.2 %	
		減衰器 (50 Ω)	10 MHz 以上 1 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.011 dB	
40 dB 超 60 dB 以下	0.014 dB					
60 dB 超 80 dB 以下	0.020 dB					
80 dB 超 100 dB 以下	0.031 dB					
1 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下		0.016 dB			
	40 dB 超 60 dB 以下		0.018 dB			
	60 dB 超 80 dB 以下		0.028 dB			
	80 dB 超 100 dB 以下		0.037 dB			
12 GHz 超 18 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下		0.022 dB			
	40 dB 超 60 dB 以下		0.024 dB			
	60 dB 超 80 dB 以下		0.039 dB			
	80 dB 超 100 dB 以下		0.046 dB			

	減衰量測定器等	18 GHz 超 40 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.028 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.054 dB
		10 MHz, 30 MHz, 1 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.007 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.010 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.016 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.024 dB
		12 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.008 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.011 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.027 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.034 dB
		18 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.013 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.016 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.070 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.058 dB
		20 GHz, 25 GHz, 30 GHz 35 GHz, 40 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.020 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.047 dB
		10 MHz 以上 1 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.011 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.014 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.020 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.031 dB
		1 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.016 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.018 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.028 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.037 dB
12 GHz 超 18 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.022 dB		
	40 dB 超 60 dB 以下	0.024 dB		
	40 dB 超 80 dB 以下	0.039 dB		
	80 dB 超 100 dB 以下	0.046 dB		
18 GHz 以上 40 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.028 dB		
	40 dB 超 80 dB 以下	0.054 dB		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
高周波 測定器等	高周波 インピーダンス 測定用素子	N 型 50 Ω Male	反射係数 $ S_{11} $ 0.1 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0015~0.0033 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0031~0.0038 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0036~0.0041 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超	振幅 U_m : 0.0040~0.0054

			14 GHz 以下	(振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 Um : 0.0049~0.0068 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
		反射係数 S _{ij} 0.3 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 Um : 0.0022~0.0037 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 Um : 0.0036~0.0046 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 Um : 0.0042~0.0047 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 Um : 0.0048~0.0060 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 Um : 0.0054~0.0074 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
		反射係数 S _{ij} 0.5 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 Um : 0.0028~0.0042 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 Um : 0.0041~0.0056 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 Um : 0.0049~0.0058 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 Um : 0.0057~0.0076 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 Um : 0.0065~0.0093 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
		反射係数 S _{ij} 1.0 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 Um : 0.0048~0.0075 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 Um : 0.0072~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 Um : 0.0084~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 Um : 0.011~0.015 (振幅ステップ:0.001) 位相[°] : arcsin(Um / 反射係数)
			14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 Um : 0.013~0.020 (振幅ステップ:0.001)

					位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
N型 50 Ω Female	反射係数 $ S_{ij} $ 0.1 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0014~0.0033 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$		
			40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0031~0.0039 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
			4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0036~0.0045 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
			8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0040~0.0051 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
			14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0045~0.0057 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
		反射係数 $ S_{ij} $ 0.3 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0021~0.0037 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0035~0.0044 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0043~0.0049 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0045~0.0058 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0050~0.0068 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
		反射係数 $ S_{ij} $ 0.5 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0027~0.0042 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$	
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0040~0.0054 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0050~0.0060 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0051~0.0070 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0056~0.0084 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
	反射係数 $ S_{ij} $ 1.0 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0046~0.0075 (振幅ステップ:0.0001)	位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$		

				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0069~0.010 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0085~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0084~0.013 (振幅ステップ:0.0001) 位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.011~0.017 (振幅ステップ:0.001) 位相[°] : $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準 約 95 %)
レーザパワー 測定器等	レーザビーム用 光パワー測定器	405 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 5 mW 以下	0.29 %
		488 nm 帯及び 515 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 200 mW 以下	0.29 %
		633 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		660 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 7 mW 以下	0.29 %
		780 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		850 nm 帯及び 1310 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 3 mW 以下	0.29 %
		1047 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		1064 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		1550 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 5 mW 以下	0.29 %
	光ファイバ用 光パワー測定器	850 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	1.0 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.5 %
			100 μ W 以上 200 μ W 以下	0.35 %
		1310 nm 帯及び 1520 nm 以上 1630 nm 以下	10 μ W 以上 50 μ W 未満	1.0 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.5 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.35 %
対象とする 測定器の種類： 光電変換型		1310 nm	1 mW	0.36 %
			100 μ W	0.41 %
			10 μ W	0.41 %
			1 μ W	0.42 %
			100 nW	0.42 %
			10 nW	0.43 %
			1 nW	0.43 %
			100 pW	0.48 %
			10 pW	0.62 %
			1 pW	1.9 %
	1280 nm 以上 1340 nm 以下	1 mW	0.36 %	
		100 μ W	0.42 %	
		10 μ W	0.42 %	
	1 μ W	0.42 %		
	100 nW	0.43 %		
	10 nW	0.45 %		

				1 nW	0.45 %			
				100 pW	0.50 %			
				10 pW	0.65 %			
				1 pW	1.9 %			
				1550 nm	1 mW	0.36 %		
					100 μW	0.39 %		
					10 μW	0.39 %		
					1 μW	0.39 %		
					100 nW	0.39 %		
					10 nW	0.40 %		
					1 nW	0.40 %		
					100 pW	0.45 %		
			10 pW		0.50 %			
			1 pW		1.5 %			
			1520 nm 以上 1630 nm 以下		1 mW	0.36 %		
					100 μW	0.42 %		
				10 μW	0.42 %			
				1 μW	0.43 %			
				100 nW	0.43 %			
				10 nW	0.43 %			
				1 nW	0.43 %			
				100 pW	0.48 %			
				10 pW	0.54 %			
				1 pW	1.5 %			
				光電検出器	光ファイバ パワー応答直線性 [1mW(0dBm)を基準 とした相対値であ り、dB表示する]	1310 nm	-10 dB	0.0091 dB
							-20 dB	0.0093 dB
			-30 dB				0.0096 dB	
			-40 dB				0.0099 dB	
			-50 dB				0.011 dB	
			-60 dB				0.011 dB	
			-70 dB				0.014 dB	
			-80 dB				0.023 dB	
			-90 dB				0.078 dB	
			1280 nm 以上 1340 nm 以下				-10 dB	0.0093 dB
							-20 dB	0.0098 dB
							-30 dB	0.011 dB
						-40 dB	0.011 dB	
						-50 dB	0.012 dB	
						-60 dB	0.013 dB	
						-70 dB	0.016 dB	
						-80 dB	0.024 dB	
			1550 nm			-10 dB	0.0056 dB	
-20 dB	0.0057 dB							
-30 dB	0.0058 dB							
-40 dB	0.0059 dB							
-50 dB	0.0061 dB							
-60 dB	0.0070 dB							
-70 dB	0.013 dB							
-80 dB	0.017 dB							
-90 dB	0.062 dB							
1520 nm 以上	-10 dB	0.011 dB						

			1630 nm 以下	-20 dB	0.011 dB
				-30 dB	0.011 dB
				-40 dB	0.011 dB
				-50 dB	0.011 dB
				-60 dB	0.011 dB
				-70 dB	0.015 dB
				-80 dB	0.018 dB
				-90 dB	0.063 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：力

法律に基づく初回登録年月日：2010年9月3日

国際MRA対応初回認定発効日：2010年9月3日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：一軸試験機 [2024年3月29日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一軸試験機	JIS B 7721 による方法	圧縮力	0.1 N 以上 5 MN 以下	0.20 %
		引張力	0.1 N 以上 100 kN 以下	0.20 %
	ASTM E4 による方法	圧縮力	0.1 N 以上 2000 kN 以下	0.40 %
		引張力	0.1 N 以上 100 kN 以下	0.30 %

登録（認定）に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録年月日：2005年2月21日

国際MRA対応初回認定発効日：2005年2月21日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：音響測定器等〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	計測用マイクロホン*1 (音圧感度レベル I形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 25 Hz 未満	0.11 dB
		25 Hz 以上 63 Hz 未満	0.09 dB
		63 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.08 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.14 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.23 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.38 dB
	計測用マイクロホン*1 (音圧感度レベル II形標準マイクロホン)	20 Hz (厳密周波数)	0.20 dB
		20 Hz 以上 31.5 Hz 未満	0.18 dB
		31.5 Hz 以上 63 Hz 未満	0.13 dB
		63 Hz 以上 125 Hz 未満	0.11 dB
		125 Hz 以上 500 Hz 未満	0.10 dB
		500 Hz 以上 8000 Hz 以下	0.10 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.12 dB
	計測用マイクロホン*2 (自由音場感度レベル I形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.3 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.4 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.5 dB
	計測用マイクロホン*2 (自由音場感度レベル II形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.3 dB
		4000 Hz 超 9000 Hz 以下	0.4 dB
		9000 Hz 超 16000 Hz 以下	0.6 dB
		16000 Hz 超 20000 Hz 以下	1.0 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベ ル I形マイクロホン)	20 Hz 以上 50 Hz 以下	0.4 dB
		50 Hz 超 3150 Hz 以下	0.3 dB
		3150 Hz 超 8000 Hz 以下	0.5 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.7 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベ ル II形マイクロホン)	20 Hz 以上 50 Hz 以下	0.5 dB
		50 Hz 超 3150 Hz 以下	0.3 dB
		3150 Hz 超 12500 Hz 以下	0.6 dB
		12500 Hz 超 20000 Hz 以下	0.9 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベ ル II形マイクロホン) (厳密周波数)	20 Hz 以上 50 Hz 以下	0.5 dB
		50 Hz 超 4000 Hz 以下	0.4 dB
4000 Hz 超 10000 Hz 以下		0.5 dB	
音響校正器(音圧レベル I形標準マイクロホン)	250 Hz	0.09 dB	
	1000 Hz	0.09 dB	
音響校正器(音圧レベル II形標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB	
	1000 Hz	0.11 dB	
複数周波数をもつ 音響校正器(音圧レベル II形標準マイクロホン)	31.5 Hz	0.14 dB	
	63 Hz	0.12 dB	
	125 Hz	0.12 dB	
	250 Hz	0.12 dB	
	500 Hz	0.12 dB	

		1000 Hz	0.12 dB	
		2000 Hz	0.12 dB	
		4000 Hz	0.12 dB	
		8000 Hz	0.12 dB	
		12500 Hz	0.13 dB	
		16000 Hz	0.32 dB	
	オーディオメータ (I 形)	音圧レベル (イヤホンの 出力)	125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.6 dB
			4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.6 dB
	オーディオメータ (II 形)		125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.7 dB
			4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.9 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

*1 カブラを使用した音圧相互校正

*2 自由音場比較校正

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	音響校正器(音圧レベル I 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.13 dB
		1000 Hz	0.13 dB
	音響校正器(音圧レベル II 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.14 dB
		1000 Hz	0.14 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：放射線・放射能・中性子

法律に基づく初回登録年月日：1998年11月16日

国際MRA対応初回認定発効日：1998年11月16日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：X線測定器、 γ 線測定器〔2024年3月29日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
X線測定器	線量測定器 (軟X線)	エネルギー範囲：10 keV (1.6 fJ) 以上 30 keV (4.8 fJ) 以下		
		照射線量	100 nC/kg 以上 30 mC/kg 以下	3.3 %
		照射線量率	2.5 μ C/(kg·h) 以上 6 μ C/(kg·h) 未満	3.5 %
			6 μ C/(kg·h) 以上 100 mC/(kg·h) 以下	3.3 %
		空気吸収線量	3.5 μ Gy 以上 1.0 Gy 以下	3.3 %
		空気吸収線量率	90 μ Gy/h 以上 210 μ Gy/h 未満	3.5 %
			210 μ Gy/h 以上 3.5 Gy/h 以下	3.3 %
		空気カーマ	3.5 μ Gy 以上 1.0 Gy 以下	3.3 %
		空気カーマ率	90 μ Gy/h 以上 210 μ Gy/h 未満	3.5 %
			210 μ Gy/h 以上 3.5 Gy/h 以下	3.3 %
	線量当量	1 μ Sv 以上 100 mSv 以下	5.2 %	
	線量当量率	25 μ Sv/h 以上 500 mSv/h 以下	5.5 %	
	線量測定器 (中硬X線)	エネルギー範囲：30 keV (4.8 fJ) 以上 200 keV (32 fJ) 以下		
		照射線量	100 nC/kg 以上 60 mC/kg 以下	3.3 %
		照射線量率	100 nC/(kg·h) 以上 6 μ C/(kg·h) 未満	3.7 %
			6 μ C/(kg·h) 以上 160 mC/(kg·h) 以下	3.3 %
		空気吸収線量	3.5 μ Gy 以上 1.8 Gy 以下	3.3 %
		空気吸収線量率	3.5 μ Gy/h 以上 210 μ Gy/h 未満	3.7 %
210 μ Gy/h 以上 5.2 Gy/h 以下			3.3 %	
空気カーマ		3.5 μ Gy 以上 1.8 Gy 以下	3.3 %	
空気カーマ率		3.5 μ Gy/h 以上 210 μ Gy/h 未満	3.7 %	
		210 μ Gy/h 以上 5.2 Gy/h 以下	3.3 %	
線量当量	3 μ Sv 以上 200 mSv 以下	5.2 %		
線量当量率	3 μ Sv/h 以上 1 Sv/h 以下	5.5 %		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
γ線測定器	線量測定器 (¹³⁷ Cs)	照射線量	52 nC/kg 以上 880 nC/kg 未満	4.2 %
			880 nC/kg 以上 250 μC/kg 以下	4.0 %
		照射線量率	52 nC/(kg・h) 以上 800 nC/(kg・h) 未満	4.4 %
			800 nC/(kg・h) 以上 16 μC/(kg・h) 未満	4.1 %
			16 μC/(kg・h) 以上 800 μC/(kg・h) 以下	3.8 %
		空気吸収線量	2 μGy 以上 28 μGy 未満	4.2 %
			28 μGy 以上 8 mGy 以下	4.0 %
		空気吸収線量率	2 μGy/h 以上 25 μGy/h 未満	4.4 %
			25 μGy/h 以上 500 μGy/h 未満	4.1 %
			500 μGy/h 以上 25 mGy/h 以下	3.8 %
		空気カーマ	2 μGy 以上 28 μGy 未満	4.2 %
			28 μGy 以上 8 mGy 以下	4.0 %
		空気カーマ率	2 μGy/h 以上 25 μGy/h 未満	4.4 %
			25 μGy/h 以上 500 μGy/h 未満	4.1 %
			500 μGy/h 以上 25 mGy/h 以下	3.8 %
		線量当量	2 μSv 以上 35 μSv 未満	5.8 %
			35 μSv 以上 10 mSv 以下	5.6 %
		線量当量率	2 μSv/h 以上 30 μSv/h 未満	5.9 %
30 μSv/h 以上 600 μSv/h 未満	5.7 %			
600 μSv/h 以上 30 mSv/h 以下	5.5 %			

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称 [登録年月日] : α/β線核種[2024年2月16日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別: 恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
α/β線核種	荷電粒子測定器	機器効率	核種: α線 ²⁴¹ Am 表面放出率: $9.4 \text{ s}^{-1} \times \text{cm}^{-2}$	9 %
			核種: β線 ³⁶ Cl 表面放出率: $14 \text{ s}^{-1} \times \text{cm}^{-2}$	9 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

※α/β線核種はMRA対応ではありません

登録（認定）に係る区分：硬さ

法律に基づく初回登録年月日：2006年3月1日

国際MRA対応初回認定発効日：2006年3月1日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：ロックウェル硬さ試験機等、ビッカース硬さ試験機等、ブリネル硬さ試験機等 [2024年3月29日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)			
				恒久的施設	現地校正		
ロックウェル硬さ 試験機等	ロックウェル硬さ 試験機	20 HRC 以上 25 HRC 以下		0.55 HRC	0.55 HRC		
		25 HRC 超 35 HRC 以下		0.55 HRC	0.55 HRC		
		35 HRC 超 45 HRC 以下		0.55 HRC	0.55 HRC		
		45 HRC 超 55 HRC 以下		0.50 HRC	0.50 HRC		
		55 HRC 超 65 HRC 以下		0.40 HRC	0.40 HRC		
ビッカース硬さ 試験機等	ビッカース硬さ 試験機	200 HV ※	試験力	0.9807 N	16 %	16 %	
				4.903 N	7.0 %	7.0 %	
				9.807 N	5.1 %	5.1 %	
				49.03 N	2.7 %	2.7 %	
				98.07 N	2.6 %	2.6 %	
		400 HV ※	試験力	0.9807 N	22 %	22 %	
				4.903 N	10 %	10 %	
				9.807 N	7.0 %	7.0 %	
				98.07 N	2.6 %	2.6 %	
				294.2 N	2.5 %	2.5 %	
		700 HV ※	試験力	0.9807 N	30 %	30 %	
				4.903 N	15 %	15 %	
				9.807 N	9.1 %	9.1 %	
				98.07 N	5.0 %	5.0 %	
				294.2 N	2.7 %	2.7 %	
		100 HV 以上 800 HV 以下 ただし、※を除く。 (試験力 0.9807 N 以上 294.2 N 以下)		くぼみ対角線長さ a) $d \leq 220 \mu\text{m}$ 576/d % b) $d > 220 \mu\text{m}$ 994/d % ただし、式中の d は μm	くぼみ対角線長さ a) $d \leq 220 \mu\text{m}$ 576/d % b) $d > 220 \mu\text{m}$ 994/d % ただし、式中の d は μm		
		ブリネル硬さ 試験機等	ブリネル硬さ 試験機	200 HBW 10/3000		6 HBW	6 HBW
				350 HBW 10/3000		6 HBW	6 HBW
				500 HBW 10/3000		10 HBW	10 HBW
				200 HBW 5/750		7 HBW	7 HBW
350 HBW 5/750				7 HBW	7 HBW		
500 HBW 5/750				10 HBW	10 HBW		
90 HBW 10/500				3 HBW	3 HBW		
100 HBW 10/500				3 HBW	3 HBW		

		100 HBW 10/1000	4 HBW	4 HBW
		200 HBW 10/1000	4 HBW	4 HBW
		* 硬さ標準片：研磨面タイプ		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：湿度

法律に基づく初回登録年月日：2006年3月1日

国際MRA対応初回認定発効日：2006年3月1日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：湿度測定器等 [2024年3月29日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)		
				恒久的施設	現地校正	
湿度測定器等	露点計	霜点 -30 °C 以上 -10 °C 以下		0.17 °C	-	
		露点 -10 °C 以上 50 °C 以下		0.10 °C		
		露点 50 °C 超 85 °C 以下		0.11 °C	-	
	校正温度 5 °C 以上 60 °C 以下			相対湿度 5 % 以上 40 % 以下	0.5 %	-
				相対湿度 40 % 超 70 % 以下	0.7 %	-
				相対湿度 70 % 超 98 % 以下	1.0 %	-
	通風乾湿計	校正温度 5 °C 以上 25 °C 以下 ただし、露点 -10 °C 以上 50 °C 以下相当の相対湿度	相対湿度 10 % 以上 98 % 以下		1.0 %	-
	電子式湿度計	校正温度 5 °C 以上 60 °C 以下 ただし、露点 (霜点) -30 °C 以上 50 °C 以下相当の相対湿度	相対湿度 5 % 以上 40 % 以下		0.5 %	-
			相対湿度 40 % 超 70 % 以下		0.7 %	-
			相対湿度 70 % 超 98 % 以下		1.0 %	-
		校正温度 50 °C 以上 95 °C 以下 ただし、露点 15 °C 以上 85 °C 以下相当の相対湿度	相対湿度 5 % 以上 35 % 以下		1.6 %	-
			相対湿度 35 % 超 54 % 以下		2.0 %	
			相対湿度 54 % 超 98 % 以下		2.8 %	
			霜点 -30 °C 以上 -10 °C 以下		0.30 °C	-
		露点 -10 °C 以上 50 °C 以下		0.30 °C		

	熱伝導率式 湿度計	絶対湿度 2.4 g/m ³ 以上 82.8 g/m ³ 以下 ただし、露点 -10 °C 以上 50 °C 以下 相当の絶対湿度	2.2 g/m ³	-
	湿度発生装置	霜点 -30 °C 以上 -10 °C 以下	0.17 °C	0.20 °C
		露点 -10 °C 以上 50 °C 以下	0.10 °C	0.20 °C
	校正温度 5 °C 以上 60 °C 以下 ただし、露点 -10 °C 以上 50 °C 以下相当の相対湿度	相対湿度 5 % 以上 95 % 以下	0.4 %	1.2 %
		相対湿度 95 % 超 98 % 以下	0.4 %	1.4 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。